

オージェ電子分光装置

機器の概要

航空機等に使用される電子部品等の試料表面から数十nmまでの深さの組成を分析する装置です。また、イオンエッチングを行うことで深さ方向の組成分布も分析可能です。

主な仕様

- ・電子銃: LaB6
- ・加速電圧: 0.1~30kV
- ・倍率: 20~300,000倍
- ・分光器: 静電半球型
- ・検出方式: チャンネルトロンによる多重検出
- ・分析エネルギー範囲: 0~3000eV
- ・イオンエッチング装置
- ・試料サイズ: 20mmφ × 4mmHまで



メーカー: 日本電子(株)
型式: JAMP-7810

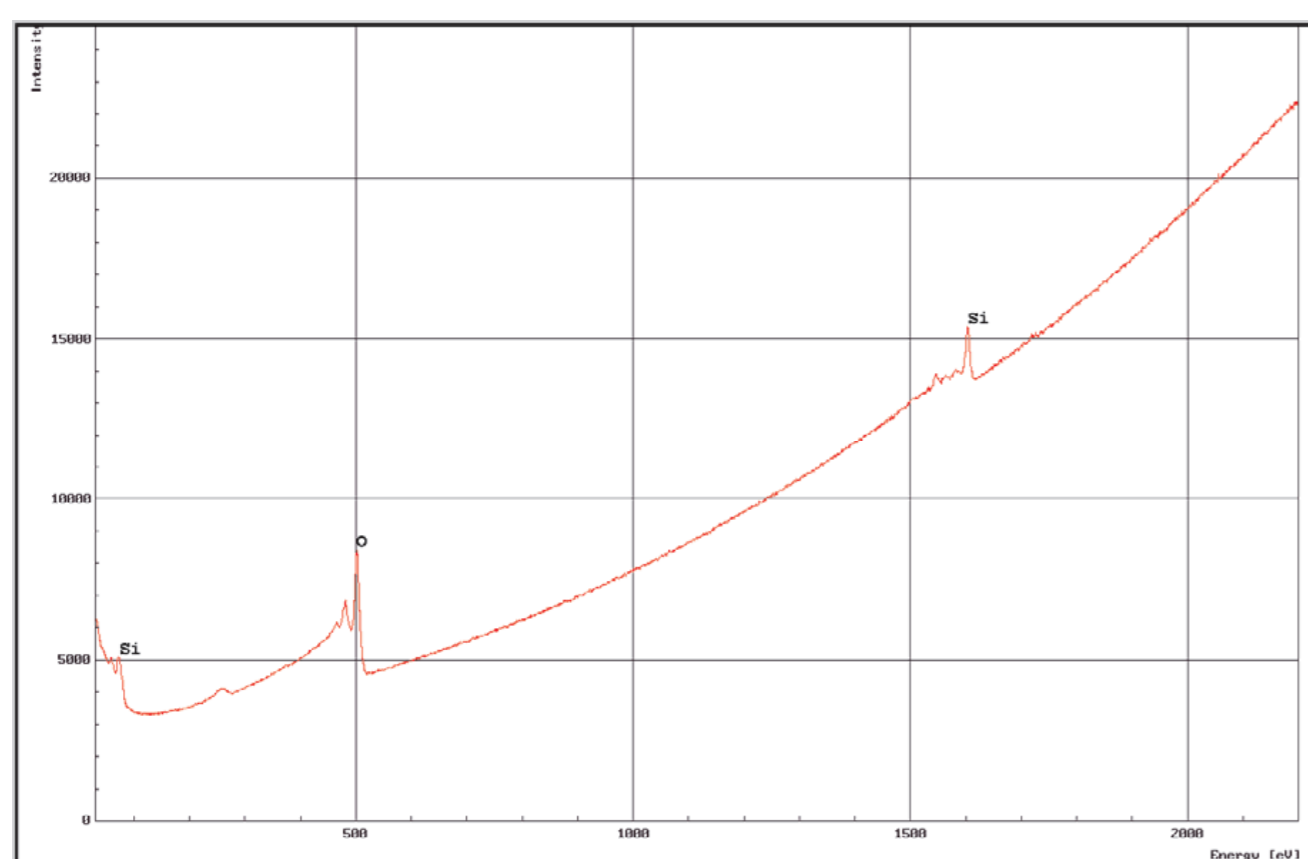
活用事例

- ・航空機搭載用電子デバイス等の**表面状態解析**
- ・航空機部品などの部材表面の機能性薄膜の**評価**

<測定例1>

SiO₂膜のオージェスペクトル分析

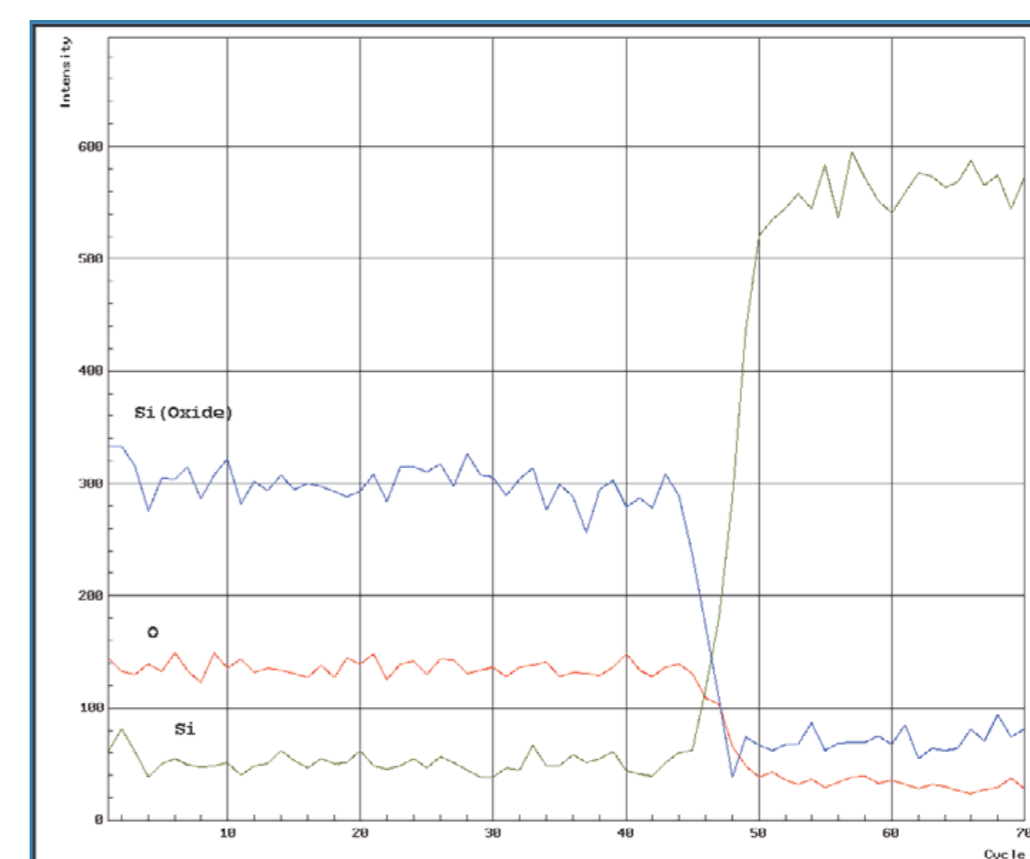
- ・試料表面数十nmの組成分析結果です。



<測定例2>

SiO₂膜のデプスプロファイル

- ・測定とイオンエッチングの繰り返しによる深さ方向の組成分布結果です。



—発信します 明日を拓く 確かな技術—



栃木県産業技術センター

Industrial Technology Center of Tochigi Prefecture



問い合わせ先: 栃木県産業技術センター 材料技術部 TEL 028(670)3397